Лекція 14-15

Рисунки та таблиці)

Таблиця 1 Алотропні модифікації карбону залежно від типу гібридизації

| Карбон | | | | | | |
|--|---|--------|----------------------------------|--|--|--|
| sp ³ | sp ² | sp | sp ³ /sp ² | | | |
| Алмаз (кубічний), лонсдейліт (гексагональний алмаз) | Графіт, графен, фулерени, астралени, нанотрубки, нановолокна, скловуглець | Карбін | Аморфний вуглець | | | |



Рис. 1. Види гібридизації електронних оболонок: a -sp3; б - sp2; в - sp



Рис. 2. Кристалічна ґратка кубічного (а) та гексагонального алмазу (б)

а аналогічний показник для алмазу – від 1000 до 2600 Вт/(м·К), залежно від чистоти кристалів.

Таблиця 2 Застосування алмазних матеріалів

| Технічне застосування | ання Тип алмазного матеріалу | |
|--|--|---|
| Зносостійкі покриття | Алмазні або алмазоподібні плівки | |
| Тепловідводи | Монокристали, полікристали, плівки | |
| Діоди, транзистори | Синтетичний алмаз, епітаксійні плівки | + |
| Лавинно-прольотні діоди | Кристали ідеальної структури | + |
| Детектори частинок и квантів, дозиметри | Природний і синтетичний алмаз, плівки | + |
| Ультрафіолетові випромінювачі | Монокристали і плівки | + |
| Інфрачервоні випромінювачі | Всі види алмазів | + |
| Термістори | Монокристали малих розмірів | + |





Рис 3. Кристалічна ґратка графіту

Рис. 4. Схематичне зображення графену



Рис. 5. Схематичне зображення вертикального польового транзистору на основі графену: 1 - шари графену; 2 - стік; 3 - керуваль-ний електрод; 4 - витік; 5 -відокремлювальний шар діелектрика (BN або MoS₂).



Рис. 6. Схематичне (а) та електронно-мікроскопічне (б) зображення нанотрубок вирощених на шарі графену з використанням безшовної технології



Рис. 7. Схематичне зображення кристалічної структури графану (а) та пористий матеріал на основі графану з приєднаними атомами лужних металів: 1 - атоми водню; 2 - атоми металу; 3 - вуглець (б).



Рис 8. Прозорий ікосаедр (а), ікосаедр із лініями відсікання вершин (б) та фулерен (в)



Рис 9. Зовнішній вигляд фулеренів: а - С₆₀, б - С₇₀, в-С₉₀





б

Рис.10. Кристалічна ґратка фулериту: а – схематичне зображення; б – об' ємний вигляд



Рис. 11. Схема отримання фулеренів із графіту



Рис. 12. Схематичне зображення польового транзистора з використанням молекули фулерену: 1 - стік; 2 - витік; 3 - кантилевер, що виконує функції затвора



Рис. 13. Електронно-мікроскопічне зображення вуглецевої нонотрубки (а) та їх «ліс нанотрубок» (б, в)



Рис. 14. Схематичне формування закритої нанотрубки (а) та зображення правого і лівого кристалів кварцу (б)



Рис. 15. Можливі індекси, вектори та кути хіральності одношарових вуглецевих нанотрубок

Базис графітового шару визначається за векторами *a*₁ і *a*₂ (рис. 15), а вектор хіральності (*Ch*) можна подати сумою:

$$C_h = na_1 + ma_2$$
, де *n і m* – цілі числа (індекси хіральності).

Зв'язок між індексами хіральності (*n, m*) і кутом О має такий вигляд:

$$\sin\Theta = \frac{3m}{2\sqrt{n^2 + nm + m^2}} \, .$$

Залежно від кута хіральності розрізняють такі типи вуглецевих нанотрубок (рис. 16):

- ахіральні зигзагоподібні (*Θ* = 0°, *C_h* = (n, 0));
- хіральні (0 < Θ < 30°, C_b = (*n*, *m*)).



Рис. 16. Схематичне зображення ОВНТ типу крісло (12, 12) (а), зигзаг (18, 0) (б) та хіральні (20, 3) (в)

У випадку повного опису геометрії нанотрубки необхідно зазначити її діаметр. Індекси хіральності одношарової нанотрубки (n, m) визначають її діаметр D:

$$D=\frac{\sqrt{3}d_0}{\pi}\sqrt{n^2+nm+m^2},$$

де d_o = 0,142 нм - відстань між сусідніми атомами вуглецю у графітовій площині. Діаметр одношарових вуглецевих нанотрубок знаходиться в діапазоні 0,3-5 нм



Рис. 17. Поперечний переріз БВНТ: а – матрьошка; б – шестикутна призма; в – згорток

Відстань між шарами в бездефектних багатошарових вуглецевих трубок залежить від початкового діаметра нанотрубки (D тр) і зменшується в міру його збільшення:

$$d_{\rm c} = 0,344 + 0,1 \cdot e^{-\frac{D_{\rm rp}}{2}},$$

де *d_c* - відстань між шарами в багатошарових вуглецевих трубках

Таблиця 3 Порівняння механічних властивостей одношаровіих вуглецевих нанотрубок (ОВНТ) та багатошарових вуглецевих нанотрубок (БВНТ)

| матеріал | к (БВПТ) Модуль Юга, ТПа | Межа міцності при розтягуванні, ГПа | Відносне подовження при розриві, % |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| OBHT ^E | 1-5 | 13-53 | 16 |
| Крісло OBHT ^т | 0,94 | 126,2 | 23,1 |
| Зигзаг OBHT ^T | 0,94 | 94,5 | 15,6-17,5 |
| БВНТ ^Е | 0,2-0,8-0,95 | 11-63-150 | - |
| Нержавіюча сталь ^Е | 0,186-0,214 | 0,38-1,55 | 15-50 |
| Кевлар* | 0,06-0,18 | 3,6-3,8 | ~ 2 |

Примітка: ^Е Експериментальні спостереження. ^Т Теоретичні дані. * Кевлар – синтетичне волокно, що має високу міцність (у п'ять разів міцніше сталі, межа міцності σ₀ = 3620 МПа)



Рис. 18. Функціоналізовані нанотрубки: 1 - інорідні атоми в пучку нанотрубок; 2 - інкапсулювання частинок усередину ВНТ (піпод - фулерени в нанотрубці); 3, 4 - ковалентна (3) та нековалентна (4) функціоналізація трубок; 5 - атомно-модифіковані нанотрубки (ВНТ модифікована атомами фтору)



Рис. 19. Процес формування нанотрубки на каталітичній частинці



Рис. 20. Зміна типу провідності нанотрубки внаслідок її деформації шляхом впровадження в графітову сітку п'яти- і семикутника



Рис. 21. Схематичне зображення польового транзистора на основі нанотрубки, з різним положенням затвору (а, б): 1 – підкладка (Si); 2 – ізолюючий шар; 3 – керуючий затвор; 4 – стік; 5 – нанотрубка; 6 – витік



Рис. 22. Відведення тепла від Si кристалу за допомогою нанотрубок



Рис. 23. Характеристики резистивного (а) та ємнісного (б) модуля сенсора від концентрації газів: 1 - CH₄; 2 - CO₂; 3 - H₂; 4 - CO

Таблиця 4. Вплив додавання багатошарових вуглецевих нанотрубок (БВНТ) на чутливість газового датчика

| Матеріал | етанол | | ацетон | | пропанол | |
|------------------------|--------------|------|--------------|------|---------------------------|-----|
| | $T, {}^{0}C$ | S | $T, {}^{0}C$ | S | <i>T</i> , ⁰ C | S |
| SnO ₂ | 120-400 | 1,55 | 260 | 1,43 | 330 | 1,7 |
| SnO ₂ :БВНТ | 330 | 8 | 360 | 12,5 | 320 | 17 |